



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



研磨輪

Poligrind
Grinding Wheels

向 Kezuru (研磨) 技術挑戰的研磨輪



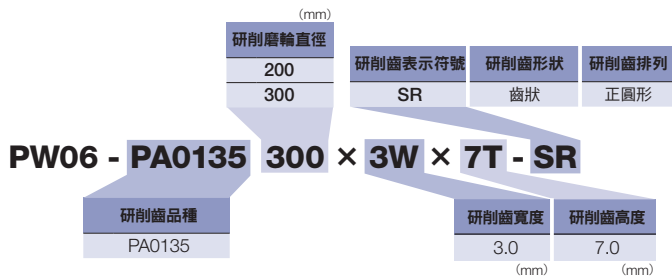
實現高品質晶背研磨的研磨輪Poligrind

在迪思科公司的晶背研磨用研削磨輪產品群中又新增加了 Poligrind (拋光性研削磨輪) 產品。通過在縱向切入式研機的精加工研削軸 (Z2 軸) 上使用 Poligrind (拋光性研削磨輪)，在不需要增加新設備及改變現有生產技術的條件下，就可改善晶圓的精加工表面粗糙度和抗折強度，獲得更高的加工品質。

- 能夠在現有縱向切入式研削機上安裝使用。
- 能夠在不改變原有加工技術的條件下，提高抗折強度等加工品質。
- 與現有的 Z2 軸 (精加工研磨) 用磨輪相比，實現了高品質的精加工表面。
- 對應高負荷研磨。



加工對象 硅(矽)晶圓、其他材料



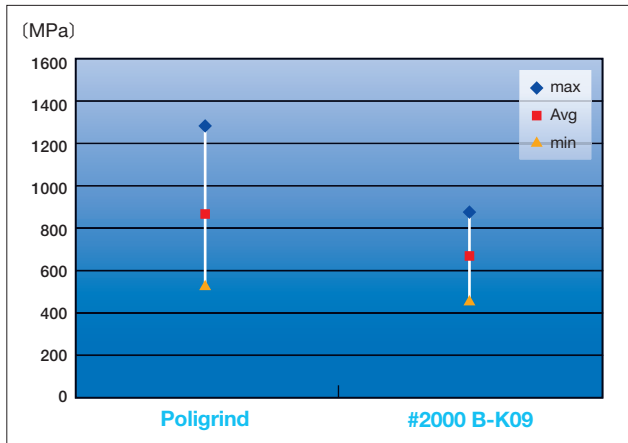
注) Poligrind的品名標識已經更新。對於使用舊品名的顧客，我們將繼續提供舊品名。



實驗結果

以現有的Z2軸（精加工研削）用磨輪相比較，可改善抗折強度和表面粗糙度，可望提高加工品質。

■ 抗折強度比較 (球壓式抗折強度測量法)

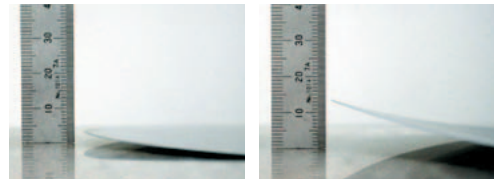


工作物 : φ8" 鏡面硅(砂)晶圓
Z2軸研削加工量 : 35 μm
最終加工厚度 : 200 μm

用戶在使用Poligrind (拋光性研磨輪)時請注意

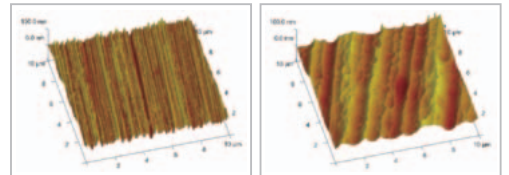
為了獲得更高的加工品質，需要重新設定最佳加工條件。為此本公司的應用技術工程師將會根據用戶的工作物和加工要求，竭誠為客戶提供最佳加工方案。

■ 翹曲度



使用Z2軸用研削磨輪	Poligrind	#2000 B-K09
翹曲度	3.5 mm	14.0 mm
工作物	: φ8" 鏡面硅(砂)晶圓	
Z2軸研削加工量	: 35 μm	
最終加工厚度	: 50 μm	

■ 表面粗糙度



使用Z2軸用研削磨輪	Poligrind	#2000 B-K09
Ra (μm)	0.009	0.015
Rmax (μm)	0.065	0.081
工作物	: φ8" 鏡面硅(砂)晶圓	
測量儀器	: 非接觸式表面粗糙度測量儀	

本公司的所有產品都已加入產品賠償責任保險。

下訂單時

在下訂單時，請用戶將產品的類型名稱、外徑、研削磨輪直徑及數量通知本公司，另外在初次訂購時，本公司銷售窗口會根據不同加工要求，協助用戶選擇最適合的產品，屆時請一併提供研削材料、尺寸、形狀、所用設備(裝置)及其他相關加工條件等資料。
• 為了改進產品，本公司可能在未通知用戶的情況下，就對產品規格進行變更，因此請仔細核對規格後再下訂單。



為了安全使用本公司的各種產品

為了預防發生因研削磨輪、切割刀片(以下通稱精密加工工具)的破損而造成的各種事故和人身傷害，請嚴格遵守下列各注意事項。

- 請使用安全擋板(包括噴嘴外殼或外蓋)。
- 在使用注有限制旋轉數的精密加工工具時，請不要超出其規定的旋轉數範圍。
- 在安裝精密加工工具時，請遵照設備(裝置)使用說明書的規定，正確地進行安裝。
- 請不要使精密加工工具掉落在地上，或發生碰撞。
- 在每次使用精密加工工具前必須先進行檢查，如果有缺口或其他破損，請停止使用。
- 在開始使用前，請仔細閱讀相關設備(裝置)的使用說明書。
- 請不要使用經過改裝的設備(裝置)。
- 請不要使用不符合設備(裝置)指定尺寸的精密加工工具。
- 除了研削、切割及切削作業以外，請不要使用在其他用途。
- 在使用濕式研削、切割用精密加工工具時，請使用冷卻液。